

차세대 디스플레이 실습교육 심화과정 커리큘럼

주 제

교 육 내 용

1주차

- ▶ 차세대 디스플레이 사전 실습 교육 #1
- ▶ 증착공정 실습 교육

- 차세대 디스플레이 사전 실습 교육 #1
- Sputter 증착 공정 : OLED 소자를 위한 투명전극, 금속전극 증착 공정 실습 교육
- PECVD 증착 공정 : Flexible OLED barrier층을 위한 SiNx/SiOx 증착 공정 실습 교육
- 유기 증착 공정 : OLED 소자 제작을 위한 유기물 증착 공정 실습 교육
- 각 공정에 필요한 분석/계측 장비 실습 교육

2주차

- ▶ 포토공정 실습교육

- 포토공정 : Wet cleaner, Coater/Developer, Etcher/Stripper, Mask Aligner 등의 공정 장비를 활용하여 OLED 소자용 기판을 위한 투명전극, 보조배선, 절연층 등 패터닝 공정 실습 교육
- 각 공정에 필요한 분석/계측 장비 실습 교육

3주차

- ▶ 차세대 디스플레이 사전 실습 교육 #2
- ▶ 인쇄전자 공정 실습 교육

- 차세대 디스플레이 사전 실습 교육 #2
- Inkjet printer, Reverse offset, Screen printing, Gravure offset printing 공정 실습 교육
- 각 공정에 필요한 분석/계측 장비 실습 교육

4주차

- ▶ Flexible 소자 제작

- 포토공정, 무기증착 공정, 프린팅 공정, 유기 증착 공정을 이용한 Flexible 소자 제작 공정
- 각 공정에 필요한 분석/계측 장비 실습 교육

차세대 디스플레이 실습교육 심화과정 커리큘럼

주 제

교 육 내 용

5주차

- ▶ 차세대 디스플레이 사전 실습 교육 #3
- ▶ 증착공정 실습 교육

- 차세대 디스플레이 사전 실습 교육 #3
- Sputter 증착 공정 : Oxide TFT에 필요한 S/D, Gate, 반도체 층 증착 공정 실습 교육
- PECVD 증착 공정 : Oxide TFT의 절연층을 위한 SiO_x, Passivation을 위한 SiN_x 증착 공정 실습 교육
- Dry etcher 식각 공정 : Oxide TFT의 Via hole 형성을 위한 식각 공정 실습 교육
- 각 공정에 필요한 분석/계측 장비 실습 교육

6주차

- ▶ 포토공정 실습교육

- 포토공정 : Wet cleaner, Coater/Developer, Etcher/Stripper, Mask Aligner 등 공정 장비를 활용하여 Oxide TFT의 각 layer 패터닝 공정 실습 교육
- 각 공정에 필요한 분석/계측 장비 실습 교육

7주차

- ▶ 차세대 디스플레이 사전 실습 교육 #4
- ▶ Oxide TFT 소자 제작공정

- 차세대 디스플레이 사전 실습 교육 # 4
- 포토공정, 증착 공정을 활용한 Oxide TFT 공정소자 제작 실습 교육
- 각 공정에 필요한 분석/계측 장비 실습 교육

8주차

- ▶ 선택장비 실습 심화교육

- 실습 장비 중 선택 장비활용 심화 교육